



X射线荧光镀层厚度测量仪

FT110A

不断进取 第八代膜厚仪

自1978年以来取得傲人销量的X射线荧光镀层厚度测量仪的第八代产品FT110A。在测量精度、操作性能、软件上有新的优化。

特点

优化的
操作性

自动对焦功能 自动接近功能

在样品台上放置各种高度的样品时，只要高低差在 80mm范围内，即可在3秒内自动对焦被测样品。由此进一步提高定位操作的便捷性。

优化的
测量精度

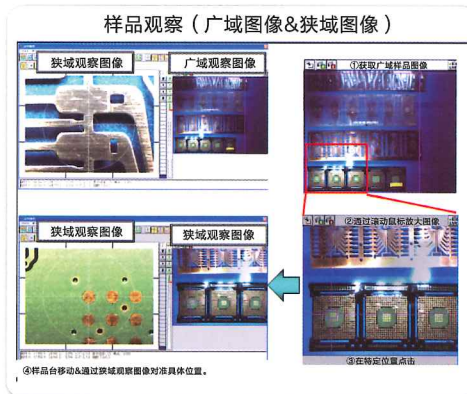
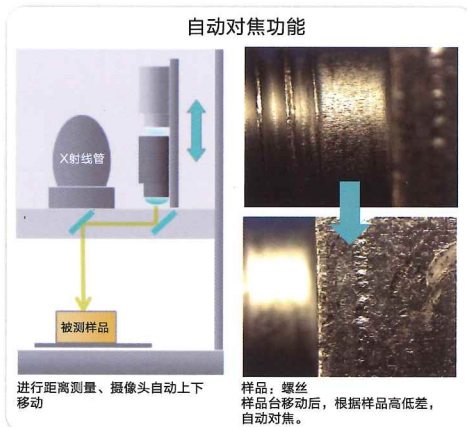
通过新·薄膜FP法提高测量精度

实现微小光束的高灵敏度，通过微小准直器提高了膜厚测量精度。镀层测量时间比本公司原有机型缩短了1/2。另外，针对检测器的特性开发了新的FP法，可进行无标样的测量。

优化的
样品观察

广域样品观察

对测量平台（250mm*200mm）上放置的样品拍摄一张静态画面后，可在获取的广域观察图像上指定狭域的观察位置。由此，可大幅减少多数测量点位置的选取时间，以及在图像上难以寻找的特定点位置的选定时间。



仪器规格

测量元素	原子序号22(Ti)~83(Bi)	膜厚测量软件	薄膜FP法
X射线管	管电压：50kV 管电流：1mA		标准曲线法
检测器	比例计数管	测量功能	自动测量、中心搜索
准直器	4种(φ0.05mm、φ0.1mm、φ0.2mm、φ0.025×0.4mm)	定性功能	KL标记、比较表示
样品观察	CCD摄像头（可进行广域观察）	使用电源	220V/7.5A
X-Ray Station	电脑+19寸液晶显示器		

X射线荧光镀层厚度测量仪 FT110A

全面提升仪器从样品放置到数据处理的各项性能！！

样品放置

- 广域图像观察 轻松定位
- 自动对焦功能 简便的摄像头对焦
- 自动接近功能 最适合位置的对焦

测量条件设定

- 新·薄膜FP法
减少检量线制作的繁琐程度、实现了设定测量条件的简易化
测量

- 新·薄膜FP法
无标样测量方法可进行最多5层的膜厚测量

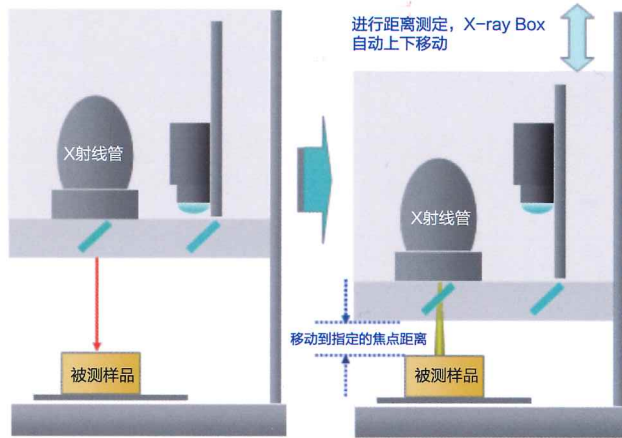
- 自动对焦功能和距离修正功能
凹凸落差的样品可通过薄膜FP法做成的相同测定条件进行测量

- 灵敏度提高
镀层测量时间比本公司原有机型缩短了1/2。

数据处理

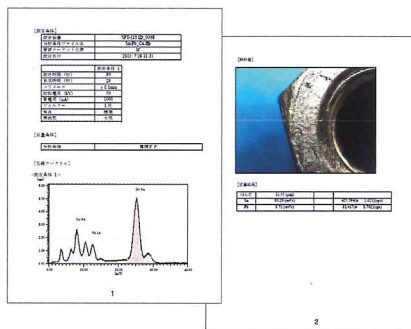
- 生成报告功能
一键生成测量结果报告书

自动接近功能



各焦点的距离修正功能的效果 (20次反复操作的平均值)

焦点距离	Au(μm)	Ni(μm)	Au误差	Ni误差
最适合距离	0.131	2.152	-	-
+10mm	0.128	2.188	2.67%	1.65%
+40mm	0.126	2.191	3.82%	1.76%
+80mm	0.138	2.054	4.96%	4.50%



生成报告样例

日立仪器(上海)有限公司

Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

上海市张江高科技园区碧波路690号2号楼102室(201203)
Tel: +86-21-5027-3533 Fax: +86-21-5027-3733

东莞分公司
广东省东莞市长安镇长青南路306号金业大厦四楼(523835)
Tel: +86-769-8584-5872 Fax: +86-769-8584-5870

株式会社日立高新技术科学
日本国东京都港区西新桥一丁目24番14号(105-0003)
Tel: +81-3-3504-3966 Fax: +81-3-3504-5189

www.hitachi-hightech.com/hhs/ (日文)
www.hitachi-hightech.com/hig/ (中文)

※关于售后服务的咨询
日立仪器(上海)有限公司 Tel: +86-21-5027-3533
※随着产品的改良有可能更改产品的规格外观等